

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	技術代行 方針 備考(注1)	成果公開 & データ提供			成果公開			成果非公開(注3) & データ提供			成果非公開(注3)			
					機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	機器利用	技術補助	技術代行 (注2)	
					(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
NPF001	電子ビーム描画装置 (CRESTEC)	CR2 エイロールドーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	6500	15000	17500	8000	16500	19000	22000	39500	43500	27300	44800	48800
NPF003	イオンコーター (FIB付帯) (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800,FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	8000	16500	20000	9600	18100	21600	21000	38500	45000	26000	43500	50000
NPF005	超高真空走査電子顕微鏡	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5200	13700	17200	6400	14900	18400	13600	31100	37600	17000	34500	41000
NPF006	マスキング露光装置	CR2 エイロールドーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	10400	18900	21400	13000	21500	24000	37600	55100	59100	47000	64500	68500
NPF008	スピコンター (フォト)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 エイロールドーム	リソグラフィ	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	8300	25800	29900	10400	27900	31900
NPF010	回転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF011	露光装置	CR3 エイロールドーム	リソグラフィ	3	技術代行専用	19500	29800	31500	24000	32500	36000	67000	84500	91000	84000	101500	108000
NPF012	ドラフトチャンバー (右)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF013	ドラフトチャンバー (左)	CR2 エイロールドーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF014	有機ドラフトチャンバー 1	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー 1	CR1 クリーンルーム	表面処理	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF016	スターウオーターバス(SWB-10L-1)	CR1 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF017	スマートウオーターバス(TB-1N)(フォト)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィ	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF018	反応性イオンエッチング装置 (RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	13600	31100	35100	17000	34500	38500
NPF019	多目的エッチング装置 (ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	10400	18900	21400	13000	21500	24000	37600	55100	59100	47000	64500	68500
NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF022	UVオゾンリナー	CR5 クリーンルーム	表面処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	8000	16500	19000	9600	18100	20600	23000	40500	44500	28600	46100	50100
NPF024	抵抗加熱真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	11400	28900	32900	14300	31800	35800
NPF025	スパッタ成膜装置 (芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	12500	30000	34000	15600	33100	37100
NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜	3	有償トレーニング	2600	11100	14600	3200	11700	15200	10400	27900	34400	13000	30500	37000
NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR1 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	4600	13100	15600	5600	14100	16600	21000	38500	42500	26000	43500	47500
NPF031	原子層堆積装置 1(FlexAL)	CR5 クリーンルーム	成膜	2	技術代行専用	8000	16500	19000	9600	18100	20600	25000	42500	46500	31000	48500	52500
NPF032	クロスセクションポリリソグラー (ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	12500	30000	34000	15600	33100	37100
NPF033	アルゴミニング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	12500	30000	34000	15600	33100	37100
NPF034	集束イオンビーム加工観察装置 (FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	13000	21500	25000	16000	24500	28000	37600	55100	61600	47000	64500	71000
NPF035	イオンコーター (SEM付帯) (2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF038	二次イオン質量分析装置 (D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	技術代行専用	9100	17600	20100	11200	19700	22200	32000	49500	53500	40000	57500	61500
NPF039	オプティカリナー (SIMS付帯)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF041	ウェハー酸化する	CR1 クリーンルーム	熱処理	1	有償トレーニング	2000	10500	11700	2400	10900	12100	8300	25800	27000	10400	27900	29100
NPF042	クリーンオープン	CR1 クリーンルーム	熱処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF045	線形分岐装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF046	定焦プローブ顕微鏡SPM 1[1[NanoscopeIV/Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	12500	16000	5000	13500	17000	13600	31100	37600	17000	34500	41000
NPF047	定焦プローブ顕微鏡SPM 2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	4000	12500	16000	5000	13500	17000	13600	31100	37600	17000	34500	41000
NPF048	アナライザー顕微鏡SPM 3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	5200	13700	17200	6400	14900	18400	17000	34500	41000	21000	38500	45000
NPF049	プローブ [N-4000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	技術代行専用	10400	18900	21400	13000	21500	24000	29000	46500	53000	36400	63900	69400
NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF051	デバイスラダー評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	8300	25800	29800	10400	27900	31900
NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	7000	24500	28500	9000	26500	30500
NPF053	デバイス容量評価装置	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	8300	25800	29800	10400	27900	31900
NPF054	ウェハースター (2F)	CR4 クリーンルーム	その他	3	有償トレーニング	4600	13100	16600	5600	14100	16600	17000	34500	41000	21000	38500	45000
NPF055	スクライパー	CR4 クリーンルーム	その他	1		500	9000	10200	500	9000	10200	4000	21500	22700	5000	22500	23700
NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他	2	有償トレーニング	1300	8800	12300	1600	10100	12600	4000	21500	25500	5000	22500	26500
NPF057	エッチングマシン(CMP)	CR4 クリーンルーム	その他	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	10400	27900	31900	13000	30500	34500
NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	12800	9300	26800	29000	11700	29200	30400
NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	12800	11400	28900	30100	14300	31800	33000
NPF063	分光エリミネーター	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	1	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	12800	10400	27900	29100	13000	30500	31700
NPF064	解析用PC(分光2F)解析室	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF065	顕微鏡レーザー分光装置 (RAMAN)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	12500	30000	34000	15600	33100	37100
NPF066	顕微鏡フーリエ変換赤外分光装置 (FT-IR)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	8300	25800	29800	10400	27900	31900
NPF067	解析用PC(CADおよびX線用)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF068	磁気特性測定システム (MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	3000	11800	14300	4000	12500	15000	9300	26800	30800	11700	29200	33200
NPF070	X線回折装置 (XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	4000	12500	15000	5000	13500	16000	13600	31100	35100	17000	34500	38500
NPF072	解析用PC(CADおよびX線用)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3	有償トレーニング	2600	11100	13600	3200	11700	14200	8300	25800	29800	10400	27900	31900
NPF073	X線光電子分光装置 (XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	2	有償トレーニング	5200	13700	16200	6400	14900	17400	12500	30000	34000	15600	33100	37100
NPF075	解析用PC(FPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析	3		500	9000	12500	500	9000	12500	4000	21500	28000	5000	22500	29000
NPF080	ヘリウムイオン顕微鏡	SCR学生管連携研究棟	観察・計測・分析	3	技術代行専用	-	-	16000	-	-	16000	-	-	(注4)	-	-	(注4)
NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置 (SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜	2	有償トレーニング	5200	13700	16200	6400	14900	17400	210					